

研究速報 : イオン感応性電界効果トランジスタを 用いた現場型pHセンサの温度圧力特性

その他のタイトル	Characterization of an ISFET(Ion Sensitive Field Effect Transistor)-based in situ pH
	sensor
著者	藤井 輝夫, ファンデルワル ピーター, 許 正憲,
	下島 公紀, デロイ ニコ
雑誌名	生産研究
巻	56
号	6
ページ	455-459
発行年	2004
URL	http://hdl.handle.net/2261/00078697

doi: info:doi/10.11188/seisankenkyu.56.455

研究速報

イオン感応性電界効果トランジスタを用いた

現場型 pH センサの温度圧力特性

Characterization of an ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor) -based in situ pH sensor

藤 井 輝 夫^{*}・ピーター ファンデルワル^{**}・許 正 憲^{*,***}・下 島 公 紀^{*,****}・ニコ デロイ^{**} Teruo FUJII, Peter VAN DEL WAL, Masanori KYO, Kiminori SHITASHIMA and Nico DE ROOIJ

1. はじめに

海水の pH を時空間的に連続して計測することは、例え ば熱水活動に代表されるような深海環境の変動の手がかり を得る上で重要な観測手法の1つである¹⁾.また、近年地 球温暖化への対応策として検討されつつある二酸化炭素の 海洋隔離にあたっても、海水中における二酸化炭素プルー ムの広がり具合を把握する必要から、3次元空間において 連続的にpHを計測することが求められている²⁾. 従来. 実験室内での pH 計測にはガラス電極による方法が用いら れてきたが、近年では、イオン感応性電界効果トランジス タ(Ion Sensitive Field Effect Transistor: ISFET)を採用した 固体素子型のpH センサも、取り扱いが手軽であることか ら広く使われるようになった³⁾. ISFET を用いた固体素子 型のpH センサは、従来のガラス電極型のものに比べ、構 造が堅牢で応答も比較的早いことなど、深海観測に適した 特徴を持つ.下島らはこの点に早期から着目し、1996年 頃より, ISFET を深海用現場型 pH センサに応用する研究 を進めてきており、すでに実海域で深海熱水地帯の計測を



2. ISFET による pH 計測

ISFET は、図1に示すように、いわゆる MOSFET(Metal





図1 MOSFET と ISFET

*東京大学生産技術研究所 海中工学研究センター

- **Institute of Microtechnology, University of Neuchatel
- ***海洋研究開発機構

****電力中央研究所

39

研

完 速 報 International Constant Constant



図2 ISFET の Vgs-Ids 特性

Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)のゲート金属膜 をイオン感応性の膜に置き換えてサンプル溶液と直接接触 させ、参照電極から溶液を介してゲート電位を与える構造 とした半導体デバイスである^{8,9)}.ここでは一般によく用 いられる n-チャネル/ p-ウェル型のデバイス構造を示し ている.一定の溶液条件の下で、参照電極とソース間の電 位 V_{gs} を変化させると図2に示すようなドレイン電流 (I_{ds}) 特性が得られる.溶液のpHを変化させると、一般にネル ンストの式で表される関係(1)に従って溶液に対するゲ ート膜の電位が変化するため、これに応じて図中に示すよ うに V_{gs} の閾値 V_{T} もシフトする.

$$E_{mtr} = const - 2.303 \text{ RT/F} \cdot pH \cdots (1)$$

ここに、 E_{gate} :バルク溶液-ゲート膜間の電気化学ポテン シャル、R:気体定数、T:絶対温度、F:ファラデー定 数である.この pH 変化によるデバイス特性のシフトを電 圧値として読み出すため、通常は V_{ds} を一定の電圧に保っ た上で、 I_{ds} を一定とするように V_{gs} を調節するフィードバ ック回路を構成し、その電圧値を pH 指示値として用い る.溶液の pH に対する電圧閾値 V_T の変化率は、ゲート 酸化膜の材料や表面状態にも影響されることが分かってお り、感度係数 β を用いて以下のように表される¹⁰⁾.

 $\partial V_{\rm T} / \partial p H = 2.303 \, \text{RT/F} \cdot (\beta / (\beta + 1)) \cdots (2)$

これまでに β の値が大きく,なおかつ溶液への溶出が小 さいゲート膜として Al_2O_3 や Ta_2O_5 などを用いたデバイス が提案されており、いずれも55 mV/pH以上の感度を実現 している.(25℃の条件での理論値は,2.303 RT/F = 59.16 mV と計算される.)

一方, ISFET の実用上問題となるのは、その使用環境条件による pH 指示値の変動である. ISFET の pH 指示値が使用温度の影響を受けることは、式(1)の右辺に温度 T が含まれていることを見ても明らかであり、この影響のみ

を考慮しても、1℃の変化あたり0.2 mV/pHの感度変化が 予想される.これに加えて、ISFETのデバイス特性そのも のが温度変化の影響を受けることも知られており¹¹⁾,正確 なpH計測を実現するためにはpH指示値の温度補償を行 う必要がある.また、長時間にわたって計測を行う際のド リフトの問題や、光感応性の問題も指摘されており、安定 した動作を実現するためのイオン感応膜の材料選択とその 製膜方法についても改良の余地がある^{12,13)}.さらに、深海 における pH の現場計測に ISFET を用いることを想定する 場合、温度条件に加えて、数百気圧(水深数千メートル相 当)までの圧力に対する ISFET の応答特性、さらには異 なる圧力下における温度特性の変化など複合的な影響等を 考慮する必要があるが、こうした特性については、これま でほとんど検討が行われていない.

3. Al₂O₃-ISFET の温度特性

ヌシャテル大学マイクロテクノロジー研究所では、Al₂O₂ ならびに Ta₂O₅をイオン感応性のゲート膜材料に用いた ISFET を製作しているが、長期計測におけるドリフト特性 ならびに光感応性による出力の安定性の観点から,本研究 では Al₂O₂ゲート膜の ISFET を用いることとした.この ISFET について温度特性テストを行った結果を図3Aに示 す. pH1, 4, 7, 10, 13の5種類の標準液について, 5℃. 25℃, 45℃の3つの温度条件で計測を行い, その出力を プロットしたもので、大気圧条件下での計測であるため参 照電極には一般に用いられる Ag/AgCl のガラス電極を用 いている.各温度条件における pH 変化に対する出力感度 S_u は図中に示すとおりであり、この感度の温度に対する 変化率 r,は 0.24 mV/pH/℃と計算され,前述の理論値に 近い値となっている、また、温度に対して出力値が変化し ない点 (Isothermal Point), すなわち各温度における曲線 の交点が存在することが知られており、ISFETの動作点 (Working Point) を調整することによって、これを pH1~ 14の範囲内に設定することが可能である.ここで用いた ISFET の場合, Working Point は $I_{ds} = 100 \mu A$, $V_{ds} = 0.5 V の$ とき、 $V_{gs} = -0.50 V$ であり、Isothermal Point は図3に示す 通り pH 6.0 (at $V_{ss} = -0.55 \text{ V}$) となっている.

 5° C ~ 45^{\coldot}C の範囲で r_t がほとんど変化せず一定である と仮定すると(実際には温度が高くなると r_t の値は少しず つ減少するが,この温度範囲ではほとんど変化しない), Isothermal Point (pH_{IP} , V_{gsIP})を基準点(不動点)として, 実際に計測を行った温度Tに対して,次式に従うような V_{es} -pH曲線を書くことができる.すなわち,

 $(\mathbf{p}_{\mathrm{H}} - \mathbf{p}_{\mathrm{H}_{\mathrm{IP}}}) = (\mathbf{V}_{\mathrm{gs}} - \mathbf{V}_{\mathrm{gsIP}}) / (\mathbf{S}_{\mathrm{pHat 5^{\circ}C}} + \mathbf{r}_{\mathrm{t}} (\mathrm{T} - 5)) \cdots (3)$

本研究で用いた ISFET について計算すると,

 $pH=(V_{gs}+0.55)/(0.0503+0.00024 (T-5))+6.0 \cdots (4)$





図3 ISFET の温度特性と補正曲線

となり、たとえば温度条件が10°Cの時、

 $pH=V_{es}/0.0515 + 16.68 \cdots (5)$

に対して出力値 V_{gs}を代入すれば,温度補正後の pH が計 算できる.(図3Bの温度 10℃の曲線参照)

4. 温度圧力特性試験のセットアップ

ISFET プローブの製作

前項に述べたように温度特性が既知で、なおかつ安定した動作が保証された ISFET について、深海における高圧 環境での使用を想定し、図4に示すようなパッケージング を行った.まず、信号接続のための配線パターンを有する プリント基板(幅7mm×長さ50mm×厚さ3mm)に ISFET をマウントし、ワイヤーボンディングによって接続 した上で、感応部(ゲート膜部分)以外をエポキシ樹脂で



図4 圧力条件下での使用を想定した ISFET プローブ



図5 温度圧力特性試験システムの構成

モールドする. 直径 12 mm (内径 10 mm)のアクリルパ イプに固体樹脂タイプの Ag/AgCl 電極 (EP4; WPI)を 参照電極として接着し, ISFET のプリント基板および参照 電極への配線を水中ケーブルと接続した後に,その配線部 分をアクリルパイプの内部に挿入し,内部に空隙が残らな いように注意深くエポキシ樹脂を流し込んで固める.ここ で,水中ケーブルの他方の末端については,耐圧コネクタ (IE 55-12-CCP; Impulse; 10,000 psi = 680 atm 仕様)で 仕上げたものを使用する.以上によって,水深 6,000 m ま での使用に耐えうる pH センサプローブが得られる.

(2) 温度圧力特性試験システムの構築

図5に温度圧力特性試験のためのシステム構成を示す. システムは一定の温度圧力条件を実現するために,圧力容 器を水槽に沈めた構成とし,水槽内の水を外部の恒温槽と の間で循環させることによって,その温度を一定に保つ. 圧力容器には手動の高圧ポンプ(1,000 atm 仕様)が接続 され,その内圧を計測するための圧力センサ(PG-1 TH; KYOWA)と,容器内を満たした水の温度を計測するため の温度センサ(Pt 100 Ω RTD: Resistive Temperature Detector)を取り付けてある.前項で用意した pH センサ プローブを圧力容器内部に格納し,水中コネクタを介して 外部のアンプ回路と接続する.アンプからの出力は,圧力

458 56巻6号 (2004)

容器内の圧力ならびに温度のデータと合わせて GPIB イン タフェースを介して PC に取り込まれる.計測に用いる溶 液はサンプルバッグに入れ, ISFET プローブを覆うよう に,その先端部分に固定する.

5. 結果と考察

構築した実験システムを用いて、5℃、25℃、45℃の3 つの温度条件について、pH4、7、10の標準液をサンプル バッグに入れて大気圧から600 atm まで加圧を行った.加 圧の過程で100 atm 毎に ISFET の出力が安定するまで圧力 を保持し、その値を記録した.計測結果の一例として、室 温条件でpH7の標準液をサンプルとして、25℃の温度条 件で一連の操作を行った結果を図6に示す.大気圧から 600 atmへの加圧によって最大1℃程度の温度上昇が見ら れるが、これは前述の ISFET の温度特性を考慮すると pH





の出力値として,0.005以下の変化である.なお,出力の 絶対値が図3に示したものと異なっているが,これは用い た参照電極やアンプ回路におけるバイアス値が異なるため である.

温度, 圧力について前述のように各々3点に加えて,常 温でも計測を行ったので,合計12ケースについて加圧, 減圧を繰り返したが,pHセンサプローブは安定した出力 を示し,水密構造や電気的な絶縁についての問題は生じな かった.このことより,本稿で述べたパッケージング法は, プローブの繰り返し使用にも耐えうることが明らかになっ た.常温での計測結果をのぞく9ケースについての結果を まとめたものを図7に示す.圧力の変化にともなって,そ れぞれ ISFET の出力も変化しており,その変化量はpHレ ンジによって異なっている.平均的には,100 atmの加圧 に対して pH 4の標準液については-2 mV,pH7について は-2.8 mV,pH10については-3.6 mV程度の出力変化が 生じており,pHが高くなるほど変化量が大きくなってい る.

6. おわりに

本稿では,深海での現場計測を目的として開発を進めて いる ISFET を用いた固体素子型 pH センサについて,その 動作原理と温度圧力特性の試験方法を紹介した.試験を行 うにあたり,十分な耐圧性能を実現するためのセンサプロ ーブの製作方法を確立すると同時に,加圧条件下での計測 実験を通して,圧力に対する出力変化の一般的な傾向を明 らかにした.今後は特に圧力条件が ISFET の出力に及ぼ す影響について,理論的な考察も含め,より詳細な検討を 進める予定である.

辞

本稿で紹介した研究成果は,筆者が文部科学省在外研究 員としてヌシャテル大学マイクロテクノロジー研究所に滞

謝



在した期間に行った研究の一部である.関係各位に深甚な る感謝の意を表す.

(2004年11月24日受理)

参考文献

- 1) 下島,許:地球化学, Vol. 32 (1998) pp. 1-11
- 2) 下島,小池:月刊地球/号外, No. 25 (2001) pp. 69-76
- 3) 例えば Shimadzu pHBOY, http://www.shimadzu-rika.co.jp/ products/product/141636.html
- 4) 下島:月刊海洋/号外, No. 19 (1999) pp. 68-73
- 5) 西来路,下島,小池,許,福場,藤井:海洋調査技術, Vol. 15, No. 2 (2003) pp. 29-35

- 6) Kyo, Shitashima, Koike, Maeda, Fujii, Sairaiji: Proc. OCEANS'03, San Diego (2003) pp. 1732–1777
- Fujii, van del Wal, Kyo, Shitashima, and de Rooij: Tech. Digest IMCS'04, Tsukuba (2004) pp. 730–731
- 8) Bergveld: IEEE Trans. BME-19 (1972) pp. 342–351
- 9) Matsuo, Wise: Trans. BME-21 (1974) p. 485
- 10) Bergveld, Sibbald: in Svehla Ed., Comprehensive Analytical Chemistry, Elsevier, Vol. XXIII (1988)
- 11) Martinoia, et al.: Sensors and Actuators B, Vol. 50 (1998) pp. 60–68
- 12) Ito: Sensors and Actuators B, Vol. 64 (2000) pp. 153-155
- 13) Ito: Sensors and Actuators B, Vol. 66 (2000) pp. 53–55